

秋田県産業技術センター 設備リスト

2017.4.3 技術イノベーション部

秋田県産業技術センター 施設・設備利用のご案内

秋田県産業技術センターでは、試験研究、技術支援・相談、技術者育成、研究会活動、研修会・講習会の開催、技術情報の提供などの業務を行っております。

当センターは、県内企業をはじめ外部の方に施設や設備機器を以下のとおり開放しております。

ご利用の留意事項

(1)利用者

特に制限はありません。

(2)利用対象施設、設備機器および使用料金

施設および設備使用料に記載しているとおりです。

(3)利用日時

原則として、当センターの休業日を除く午前9時から午後5時までです。

(4)利用・申し込み方法

あらかじめ電話等により、対象設備、利用日時等をご連絡のうえ、当日まで申請手続きが必要です。
使用が可能な場合は、許可証を交付します。

(5)使用方法

設備機器の使用方法については、必要に応じて当センター職員が指導します。

(6)支払い方法

当センターで発行する納入通知書により、指定金融機関に納付ください。

(7)ご利用にあたっての遵守事項

- ①会議室等の使用に際しての机、椅子の準備および復旧は、使用者の責任において行ってください。
- ②茶器は無償で貸付しますが、消耗品はお持ちいただき、後片付けは使用者の責任において行ってください。
- ③館内は禁煙です。
- ④設備機器のご利用にあたっては、原則として危険物および有害物質の持ち込みを禁止します。
- ⑤当センターの施設および設備機器をき損した場合は、直ちに届出願います。
故意または過失によると認められる場合には、損害賠償の責任が生じますので、ご注意ください。

【申し込み・照会先】

秋田県産業技術センター 技術イノベーション部
〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4番地の1 1
TEL 018-862-3420
FAX 018-865-3949
Eメール soudanshitu@rdc.pref.akita.jp
ホームページ <http://www.rdc.pref.akita.jp>

施設使用料および設備使用料

1. 開放研究室

(1) 本館

区分	面積(m ²)	室数	使用料金(円/月)
開放研究室A	59	1	69,800
開放研究室B	46	6	66,700
開放研究室C	40	2	44,400

(2) 高度技術研究館

区分	面積(m ²)	室数	使用料金(円/月)
高機能開放研究室	61.44	5	97,800

2. 講堂・研修室・会議室・展示室

(1) 本館

区分	収容人数	使用料(円)		
		9:00-12:00	13:00-17:00	9:00-17:00
講堂	100	3,600	4,800	8,400
研修室B	20	1,200	1,600	2,800
展示室	1,350(1日)			

以下の付属備品が利用できます(無料)ので、施設の使用申請の段階でお申し込みください。

液晶プロジェクタ、VHSビデオデッキ、スクリーン、ホワイトボード
オーバーヘッドプロジェクタ、黒板、ワイヤレスマイク

(2) 高度技術研究館

区分	収容人数	使用料(円)		
		9:00-12:00	13:00-17:00	9:00-17:00
視聴覚研修室	100	9,750	13,000	22,750
研修室A	24	3,600	4,800	8,400

付属設備

区分	使用単位	使用料(円)	
視聴覚研修室	一式1時間につき	映像装置	2,100
		同時通訳装置	1,600
研修室A	一式1回につき	オーバーヘッドプロジェクター	520
		拡声装置	520

3. 機器設備

次頁以降の一覧表をご参照ください。

(注1) 使用時間が1時間未満である時、または当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料となります。

(注2) 付属装置の設備使用料が追加される場合があります。

秋田県産業技術センター機器設備一覧

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
1	PC制御画像認識塗布システム	武蔵エンジニアリング株式会社	SHOTMASTER SM300DSS-3A+IMAGE MASTER 350PCSmart	28	220	熊谷
2	放射線(α線、β線、γ線)測定器	日立アロカメディカル(株)	TCS-362,TCS-172B,ICS-323C	23	100	遠田
3	ガウスメータ	ベル	9903	4	940	丹
4	シグナルジェネレータ	アジレントテクノロジー	E4426B	14	110	丹
5	低雑音振幅器	MITEQ	NSP2000-P	17	100	丹
6	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	NF 3660	4	430	丹
7	フォトレシーバ	NewFocus	1544-B-50	22	100	丹
8	電源ノイズ測定器	(株)TFF(テクトロニクス)	MDo4104-6	23	250	佐々木(大)
9	全光束測定システム	オーシャンフォトニクス	OP-FLUX-76-CA	23	2,350	梁瀬
10	精密騒音計	リオン(株)	NL-52	25	100	内田(勝)
11	非接触三次元デジタイザ	Steinbichler	COMET	21	1,950	内田(富)
12	CNC3次元測定機	カールツァイス(株)	PRISMO 5 HTG-S	7	460	加藤
13	真円度測定機	ランクテラーホブソン	タリロンド262型	8	100	加藤
14	CNC三次元測定機用データ処理装置	(株)東京精密	Calypsoシステム	18	830	加藤
15	超高倍率三次元複合顕微鏡	島津製作所	ナノサーチ顕微鏡SFT-3500ほか	17	1,650	加藤
16	非接触形状測定顕微鏡	キーエンス	VK-9500	15	1,000	加藤
17	表面粗さ測定機	(株)東京精密	サ-フコム3000A-3DF-DX-S	13	110	加藤
18	高精度CNC画像測定機	(株)ニコンインステック	NEXIV VMZ-R6555	27	790	加藤
19	総合型金属顕微鏡	オリンパス(株)	DSX500,DSX100	25	530	内田(富)
20	超高精度三次元測定器	Panasonic	UA3P-300	20	2,900	久住
21	非接触式表面性状評価装置	Zygo	NewView6300	19	1,150	久住
22	非接触式フィゾー干渉計	Zygo	GPI XP/D	19	570	久住
23	4インチ光学原器	Zygo	TS f/0.65, f/1.5, f/3.3	21	300	久住
24	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	ZYGO	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	23	130	久住
25	高精度3次元プロッターシステム	OBJET	CONNEX500	21	7,200	内田(富)
26	鋳造CAEソフトウェア	クオリカ	JSCAST	14	100	内田(富)
27	熱処理CAEソフトウェア	クオリカ	GRANTAS	14	100	内田(富)
28	熱変形シミュレーションシステム	MSCソフトウェア	simxpert	21	1,550	内田(富)
29	ハイエンド3次元CAD/CAMシステム	PTC社	Pro/ENGINEER Wildfire 4	10	100	内田(富)
30	3D鋳型積層造形装置	シーメット社	IS-800SA	27	4,850	内田(富)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
31	3次元X線CTシステム	(株)東芝	TOSCANER-32300 μ FD	28	2,800	内田(富)
32	3次元CADシステム	DASSAULT SYSTEMS	SOLID WORKS2015	28	490	黒沢(憲)
33	空圧落下衝撃試験装置	ボックス・ブラウン(株)	SM-1110-MP型	3	100	近藤(康)
34	振動試験機	エミック株式会社	F-03000BM/FA	16	1,200	佐々木(信)
35	再資源化焼結炉	アドバンテック東洋(株)	KS-1703型	7	150	遠田
36	管状炉	タナカテック	MPH-6VGS	15	520	遠田
37	炭化賦活炉	(株)ウエーブニター	炭化賦活炉 T-2000L	16	1,200	遠田
38	絶縁耐圧試験器	日置電機(株)	3159	14	100	近藤(康)
39	高周波3次元電磁界シュミレータ	アンソフト	HFSSV・10・0	17	960	丹
40	三次元電磁界最適化設計ツール	アンソフト・ジャパン(株)	Optimetrics	18	100	丹
41	電磁界解析用ワークステーション	DELL	PrecisionT5400	20	100	丹
42	ロックインアンプ	Anfatec Instruments	eLockIn205/2	25	100	丹
43	差動プローブセット	ソニー・テクトロニクス	P6330・P5210・TCP202S	14	100	佐々木(信)
44	ネットワークプロトコル開発ツール	Scalable Network Technologies, Inc.	Qualnet Developer	18	1,000	佐々木(信)
45	光テストシステム装置	横河電機	AQ2200	17	700	佐々木(信)
46	ベクトルシグナルジェネレータ	アジレント	V2920A	21	310	佐々木(信)
47	ミックスドシグナルオシロスコープ	日本テクトロニクス	MSO4104	20	100	佐々木(信)
48	ソフトウェア品質評価試験システム	株式会社ハートランドデータ	DT10 STD Value IVセット	26	250	佐々木(信)
49	計測制御ソフトウェア開発システム	National Instruments(株)	LabVIEW 2010プロフェッショナル開発システム	23	100	佐々木(大)
50	プレジジョンパワーアナライザ	横河電機(株)	WT3000	23	170	佐々木(大)
51	ネットワーク・アナライザ・システム	アジレント・テクノロジー(株)	E8364A	14	1,250	千葉(隆)
52	摂動方式誘電率測定システム	キーコム株式会社	摂動方式試料穴閉鎖形空洞共振器法比誘電率・誘電正接($\epsilon_r, \tan \delta$)測定システム	18	310	千葉(隆)
53	総合熱分析装置	セイコー電子工業(株)	EXSTAR6000	8	870	杉山
54	電気伝導率・熱電率測定装置	真空理工(株)	ZEM/PEM-1型	9	1,400	杉山
55	高温動弾性率測定装置	東芝タンガロイ(株)	UMS-HL	10	3,350	杉山
56	ナノインデント	米国Hysitron社	Model Triboscope他	14	3,000	杉山
57	熱特性測定装置	NETZSCH	LFA457-A21 MicroFlash	21	1,200	杉山
58	熱膨張測定装置	理学電機	Thermo Plus 2	15	460	杉山
59	電界放射走査電子顕微鏡	日立製作所	S-4500	8	610	木村
60	S-4500用オートステージ	日立製作所	S-8432型	12	100	木村
61	電子プローブマイクロアナライザ	日本電子(株)	JXA-8200ほか	13	1,650	杉山
62	圧縮成形機	東洋精機(株)	試験用加硫プレス 30ton f	S58	280	工藤(素)
63	プラスチック衝撃試験機	上島製作所	シャルピー JIS7111	S58	100	工藤(素)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
64	恒温恒湿器	タバイエスペック(株)	LHU-112M	9	100	工藤(素)
65	3D射出成形シミュレーションシステム	富士通(株)	CELSIUS W480-NTM	23	1,150	工藤(素)
66	マイクロオームメータ	アジレント・テクノロジー(株)	34420A	18	100	工藤(素)
67	流動特性評価装置 (フローテスター)	(株)島津製作所	フローテスタ CFT-500D パソコンシステム	14	270	工藤(素)
68	示差走査熱量計	セイコーインスツルメンツ株式会社	X-DSC7000	23	620	工藤(素)
69	プラスチック万能材料試験機(CFRP用)	インストロン(株)	5967型	24	930	工藤(素)
70	メルトインテグサ	(株)東洋精機製作所	型式G-01	25	250	工藤(素)
71	真空加熱プレス装置	井元製作所	1824型	19	100	杉山
72	電子天秤	ザルトリウス(株)	MC210S	10	100	工藤(素)
73	3次元CAD/CAMシステム	ダッソーシステムズ	CATIA V5他	19	1,600	加藤
74	色彩色差計	日本電色工業(株)	SQ-2000	12	290	工藤(素)
75	表面抵抗測定装置	アジレント・テクノロジー(株)	4339B	16	110	工藤(素)
76	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光(株)	IRT-7000	21	820	工藤(素)
77	粘弾性測定装置	Anton Paar社	MCR302	26	1,100	工藤(素)
78	低高抵抗率測定システム	(株)三菱アナリック	ロレスタMCP-T610,ハイレスタMCP-HT800	26	200	野辺
79	プラスチック自動比重計	東洋精機製作所	DSG-1	28	100	野辺
80	電動式塗工機	(株)小平製作所	YOA-B型	18	100	杉山
81	比表面積測定器	湯浅アイオニクス(株)	モノソープ	2	340	菅原
82	小型電気炉	(株)セイシン企業	PART-3	2	260	菅原
83	低温恒温水槽	小松エレクトロニクス	DW-621	8	100	菅原
84	全有機体炭素計	島津製作所	TOC-5000A	11	550	菅原
85	セミビッカース硬度計	マツザワ	PVT-7S	21	420	杉山
86	超硬製転動ミル用容器	(株)伊藤製作所		20	100	杉山
87	マイクロビッカース硬度計	(株)マツザワ	AMT-X7FS-B	28	260	杉山
88	X線回折装置	リガク	RINT-2500	9	710	菅原
89	X線応力測定装置	(株)マックサイエンス	MXP3AHP	7	1,700	木村
90	スクラッチ試験機	新東科学(株)	TYPE. 22H	6	390	木村
91	微小硬さ試験機	(株)フィッシャー・インストルメンツ	H-100	14	480	木村
92	原子吸光分光分析装置	日本ジャーレールアッシュ	SOLAAR M-6	15	1,100	工藤(素)
93	酸素・窒素分析装置	(株)堀場製作所	EMGA-620W/C	13	1,350	工藤(素)
94	炭素・硫黄分析装置	LECO社	CS-200型	13	870	工藤(素)
95	ラマン分光光度計	日本分光(株)	NRS-1000/RFT-600	12	1,350	工藤(素)
96	高周波プラズマ発光分光分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社	iCAP6300 Duo	23	3,600	工藤(素)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
97	低温灰化装置	ヤマト化学	PDC-210	15	670	工藤(素)
98	電気マッフル炉	アドバンテック東洋	FUS612PA	15	350	工藤(素)
99	ドラフトチャンバー	(株)ダルトン	DFB11-DFC14,DFD31	27	720	工藤(素)
100	精密旋盤	池具鉄工	D-20型	S47	260	加藤
101	ドリル研削盤	(株)藤田製作所	DG36A形	S55	220	加藤
102	NCフライス盤	遠州製作(株)	TNC 6MB付	S57	1,700	加藤
103	NC精密成形研削盤	(株)岡本工作機械	NFG-52 6M付	S57	1,650	加藤
104	圧電型切削動力計	日本キスラー(株)	9257B	2	670	加藤
105	コンターマシン	アマダ	V-400	S47	100	加藤
106	直立ボール盤	(株)吉田製作所	YUD600	S47	100	加藤
107	卓上ボール盤	吉田鉄工所	YBD-420B	S46	100	加藤
108	超精密成形形状研削盤	ナガセインテグレックス	SGC-630S4AK-Pcnc	22	3,600	加藤
109	ミスト冷風供給装置	(株)荏原製作所	アイストZELSR0401	12	130	加藤
110	油圧式強力高速弓鋸盤	津根マシンツール	PSB-350U	12	280	加藤
111	ワイヤーカット放電加工機	(株)ソディック	AQ360L	18	990	加藤
112	5軸制御立形マシニングセンタ	オークマ(株)	MU-400V II 型	26	2,700	加藤
113	プラスチック粉碎機	ホーライ	VC3-360	12	240	工藤(素)
114	LN2サブゼロ装置	(株)フロンティアエンジニアリング	I 型	7	110	内田(富)
115	エコーチップ硬さ試験機	プロセク社(スイス)	D型	S60	120	内田(富)
116	鋳型焼成雰囲気炉	日新化熱工業(株)	EBS-9(改)	10	1,300	内田(富)
117	チタン用精密鋳造機	吉田キャスト	YSE-100	28	1,250	内田(富)
118	複合サイクル腐食試験機	スガ試験機	CYP-90	20	290	菅原
119	高速精密切断装置	平和テクニカ(株)	ファインカットN-100	4	710	木村
120	マイクロフォーカスX線装置	日本フィリップス(株)	HOMX-161	5	1,800	木村
121	プレス付真空熱処理装置	東京真空(株)	PRESS-VAC-2	3	570	木村
122	YAGレーザ加工装置	石川島播磨重工業	iLS-YC-30B	11	6,900	木村
123	交直両用TIG溶接機	(株)ダイヘン	AVP-3000P	13	730	木村
124	真空チャンバー	日本精機	φ500×H250mm(内寸)材質:SUS304	14	280	木村
125	溶接部可視化装置	石川島播磨重工業(株)	ILV型	12	100	木村
126	YAGレーザ用ロボットシステム	安川電機株	MOTOMAN-UP6型	13	100	木村
127	冷間等方加圧成形装置	アプライドパワージャパン(株)	CIP-50-2000	7	310	杉山
128	多目的高温炉	富士電波工業	ハイマルチ5000	8	1,000	杉山
129	放電プラズマ焼結装置	住友石炭鉱業(株)	SPS-2080	8	5,300	杉山
130	極間式磁気探傷機	日本工機	BY-1	S43	100	木村

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
131	超音波映像装置	日立エンジニアリング・アンド・サービス	FS200 II	22	1,750	木村
132	磁気探傷機	(株)島津製作所	PRA-80型	S46	230	木村
133	超音波探傷器	東京計器	SM80型	S53	500	木村
134	X線透過検査装置	理学電気工業(株)	300EG-B2L型	S55	980	木村
135	JSNDI仕様デジタル超音波探傷器	GEインスペクション・テクノロジーズ・ジャパン(株)	USM35X JE	23	150	木村
136	3Dプリンターシステム	STRATASAS	FORTUS250mc	25	1,100	沓澤
137	ロックウェル硬さ試験機	(株)アカシ	ATK-F1000	7	190	内田(富)
138	ビッカース硬度計	(株)アカシ	AVK-C2500	4	100	内田(富)
139	XY自動テーブル付硬度計	明石製作所	MS-4	S60	250	内田(富)
140	試料研磨琢磨機	ビューラー	エコット4000	20	710	内田(富)
141	電解研磨装置	ストルアス社	ポレクトロール	9	230	木村
142	セラミックス研磨装置	丸本ストラウス(株)	アブラミン	10	2,600	杉山
143	セラミックス自動精密切断機	丸本ストラウス(株)	アキュトム50	11	390	杉山
144	万能材料試験機	Instron	5985	22	2,400	木村
145	小型造粒機	日本アイリッヒ(株)	アイリッヒ逆流式高速混合機RVO2型	2	200	菅原
146	ふるい振盪機	テラオカ	S-1	3	100	菅原
147	ボールミル	日陶科学	架台二連式AN-3S無段変速28~100bpm	1	100	菅原
148	中型電気炉	(株)モトヤマ	SH-3045E	10	890	菅原
149	乾式粉体表面改質装置	(株)奈良機械製作所	NHS-0型(閉回路)	9	820	菅原
150	遊星回転ボールミル	(有)伊藤製作所	LA-PO412	8	210	杉山
151	スプレードライヤー	大川原化工機(株)	NHS-0型	9	550	杉山
152	アトライタ	日本コークス工業(株)	MAISE-X	25	340	杉山
153	真空乾燥用ミキサ	日本コークス工業(株)	FMミキサ、FM10C/I-X型	26	900	杉山
154	真空溶解炉	富士電波工業(株)	FVPM-10型	7	1,850	内田(富)
155	ニューマブラスター	(株)不二製作所	FDQ-4S	S57	300	内田(富)
156	動的ひずみ解析装置	(株)共和電業	EDX-1500A-16AC	10	100	内田(富)
157	引張・圧縮疲労試験機	島津製作所	EHF-EG50KN-10L	11	2,700	内田(富)
158	発光分析装置	(株)SPECTRO Analytical	SPECTROLAB M	14	1,300	内田(富)
159	シャルピ衝撃試験機	(株)島津製作所	30kgm型	S54	130	内田(富)
160	小野式回転曲げ疲労試験機	(株)島津製作所	H6型	S62	100	内田(富)
161	スガ摩耗試験機	スガ試験機(株)	NUS-ISO-3型	1	170	内田(富)
162	摩耗試験機	(株)エー・アンド・ディ	EFM-3-EM	9	410	内田(富)
163	高温雰囲気クリープラプチャー試験装置	東伸工業	VGRT-30S	11	100	内田(富)
164	万能試験機	島津製作所	UH-F300kNI	19	690	木村

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
165	転写性評価用金型	日本分光(株)	プリハードン鋼	10	100	工藤(素)
166	射出圧縮成形装置	ファナック(株)	ROBOSHTO α-100C	9	1,700	工藤(素)
167	精密微量水分計	(株)チノー	CZA-3000	13	110	工藤(素)
168	ノズル樹脂圧力・温度計	日本キスラー(株)	4085A5A2	13	100	工藤(素)
169	標準試験片作製金型	AXXICON社	AIM Mould System	13	230	工藤(素)
170	押出機	(株)テクノベル	KZW25TW-60MG-NH(1200)スクリュー径25φ	16	1,600	工藤(素)
171	集塵機	アマノ(株)	PIE45	18	480	工藤(素)
172	樹脂乾燥機	アドバンテック東洋	DRL823WA	16	220	工藤(素)
173	磁束密度測定装置	F.W.BELL	9550	9	120	久住
174	砥粒分散用超音波発生器	トミー精工	UD-201(S)	13	100	久住
175	平坦度測定装置	(株)ニデック	FT-900(ウェハ用)	25	1,250	久住
176	電界制御装置	トレック・ジャパン(株)	MODEL20/20B	10	100	久住
177	小型切削動力計	日本キスラー株式会社	9256C2	16	490	久住
178	三脚	スリック	プロフェッショナルデザインⅡ	12	100	久住
179	自動研磨ヘッド	ビューラー	オートメット2000 60-1970	20	100	久住
180	除振台	明立精機	AYA-1809K4	21	100	久住
181	レーザー変位計	キーエンス	LC-2400	14	100	久住
182	電界砥粒制御用小型片面研磨装置	ビューラー	エコメット250/オートメット250	28	150	久住
183	電源装置	トレックジャパン(株)	MODEL609D-6	7	190	久住
184	15MHzファンクションウェーブジェネレータ	日本ヒューレットパッカード	33120A	11	100	久住
185	オシロスコープ	日本ヒューレットパッカード	HP-54645A	11	100	久住
186	安全キャビネット	エアーテック	BHC-1006ⅡA/B3	20	100	久住
187	核酸増幅システム	三洋電機バイオメディカ(株)	MDF-192	17	310	久住
188	蛍光顕微鏡	ニコン	E400-RFL 1	15	200	久住
189	材料物性測定装置	東陽テクニカ	1260-MAS(ソーラートロン)	18	690	久住
190	3軸微細加工機	シグマテック	FS-1100PXY	15	820	久住
191	CCDカラーカメラ	東京電子	CS5270i-S	12	100	久住
192	ゼータ電位測定装置	Systemex	Nano Z	19	330	久住
193	砥粒挙動モニター用レンズ	モリテックス	ML-Z07545他	12	100	久住
194	誘電率測定用サンプルホルダー	東陽テクニカ	SH2-Z	25	100	久住
195	動的光散乱式測定装置	(株)Malvern	ゼータナノサイザー ナノZSP	26	800	久住
196	サーマルサイクラー	Bio-Rad	T100	27	100	中村
197	プレートリーダー	Bio-Rad	iMark PCシステム	27	100	中村
198	蛍光式光ファイバー温度計	安立計器	FL-2000	28	100	中村

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
199	フローサイトメーター	ベックマン・コールター社	CytoFLEX 3レーザー13カラー	28	1,200	中村
200	研磨装置	不二越機械工業	SLM-140	22	480	久住
201	片面研磨装置	不二越機械工業(株)	SLM-140改	25	550	中村
202	高速引張試験機	島津製作所	HITS-T10	21	2,350	木村
203	落錘衝撃試験機	INSTRON	9205HV	21	1,450	木村
204	材料試験高速解析システム	(株)フォトロン	FASTCAM SA-X	24	780	木村
205	減圧除湿乾燥機	カワタ(株)	DV-30	26	250	野辺
206	高転写成形用急加熱冷却金型システム	山下電気(株)	超臨界発泡射出成形機用金型	26	1,100	野辺
207	熱電発電モジュール温度特性評価試験装置	サカタ理化学(株)	MS-010	24	520	杉山
208	立形マシニングセンタ用集塵防塵装置	アマノ	PIE-30SD	22	760	加藤
209	立形マシニングセンタ	ファナック	α -T14iD	16	460	加藤
210	超臨界発泡射出成形機	日精樹脂工業株式会社	NEX180Ⅲ 25E	24	3,000	工藤(素)
211	複合材料圧縮成形装置	(有)郷製作所	MBO05-GMS	27	1,400	工藤(素)
212	複合材硬化成形用オートクレーブ	株式会社 羽生田鉄工所	ϕ 850 x 1500L	21	1,450	藤嶋
213	複合材料切断機	(株)丸東製作所	AC-300CF	22	570	藤嶋
214	フラットベット切断機	(株)ミマキエンジニアリング	CF2-1215RC-S	25	750	藤嶋
215	パワーマルチメーター	横河電気	WT1030	8	100	小笠原
216	磁気抵抗効果測定用電磁石	マイテック	ヘルムホルツコイルM-HD31型	6	210	丹
217	高出力増幅器	日本オートマチックコントロール	150A100B-150W1000	16	360	丹
218	バイポーラ電源	高砂製作所	BWS80-30G	16	190	丹
219	ワイヤーボンダー	TPT	モデル16	16	270	丹
220	バイポーラ電源	松定プレジジョン	POEF60-20	27	100	丹
221	放射電磁界イミュニティ試験システム	アンプリファイヤーリサーチ社	TC2000C	15	1,050	佐々木(信)
222	プリント基板加工システム	日本LPKF株式会社	Protomat C100HF	16	450	佐々木(大)
223	直流安定化電源	菊水電子工業(株)	PAT80-100T WITH USB	27	180	佐々木(大)
224	電子負荷装置	菊水電子(株)	PLZ1004WH	27	100	佐々木(大)
225	重量級ブラットホーム型電子天秤	エー・アンド・ディ	FW-300KA4	9	100	沓澤
226	雷サージ試験システム	(株)ノイズ研究所	LSS-15AX-C1/S	13	100	近藤(康)
227	静電気試験システム	ノイズ研究所	ESS-2000	14	100	近藤(康)
228	耐候性試験機	岩崎電気(株)	SUV-W161	25	1,500	近藤(康)
229	グローワイヤー試験機	Physics tecnic's Labor	TA03.35(付属チャンバBT-07)	25	310	近藤(康)
230	雑音総合評価試験機	(株)ノイズ研究所	MODEL EMC-5000S	1	870	佐々木(信)
231	ファストランジェント/パースト試験機	(株)ノイズ研究所	FNS-AX3-B50B	26	150	佐々木(信)
232	低温恒温高湿器	エスペック	PSL-2K	19	240	佐々木(大)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
233	冷熱衝撃装置	エスペック(株)	TSA-71S-W	17	590	佐々木(大)
234	衝撃波記録解析装置	Lansmont社	Test Partner TP3-USB	26	100	近藤(康)
235	複合環境試験装置	IMV株式会社	EM2502(1250/SA5M)(振動試験機本体)Syn-3HA-40(恒温恒湿槽)	26	1,700	佐々木(信)
236	真空乾燥器	EYELA	VOS-450SD	9	120	遠田
237	自動研磨装置	ピューラー社	AUTOMET2&ECOMET3	9	170	遠田
238	スクラパー付ドラフトチャンバー	オリエンタル技研工業(株)	GENE-1500N	9	170	遠田
239	発熱量測定装置	(株)島津製作所	CA-4PJ	10	100	遠田
240	粉塵ドラフト	オリエンタル技研(株)	GNS-1800S	10	100	遠田
241	排ガス分析装置	(株)島津製作所	GC-17A	10	110	遠田
242	CHN元素分析装置	(株)パーキンエルマー・ジャパン	24002CHNS/0	10	210	遠田
243	燃焼灰品質評価装置	日機装	マイクロトラックHRA-X-100	9	970	遠田
244	焼成挙動評価装置	ライカ	DMRXP	9	590	遠田
245	波長分散型蛍光X線装置	島津製作所	XRF-1700(4KW)	11	900	遠田
246	ガスクロマトグラフ質量分析装置	横河アナリティカルシステムズ	Agilent 5973W	12	170	遠田
247	ガスクロ用オートインジェクター	島津製作所	AOC-20i	16	100	遠田
248	GC用熱分解装置	(株)島津製作所	PY-2020iD	21	520	遠田
249	サイクロンサンプルミル	静岡精機(株)	CSM-F1	20	100	遠田
250	ハロゲン化合物測定自動前処理装置	三菱化学(株)	AQF-100	18	720	遠田
251	ビード作製装置	東京科学(株)	TK-4100型	16	790	遠田
252	ハンディ型燃焼排ガス分析計	(株)テストー	t350システムXL	23	120	遠田
253	粒度分布測定装置	日機装(株)	MT3300EX2-SDC-H	25	570	遠田
254	赤外線サーモグラフィカメラ	日本アビオニクス(株)	R300SR-H	26	100	遠田
255	ハロゲン化合物測定用検出器	Thermo SCIENTIFIC 社	ICS-1600	26	400	遠田
256	ガス蒸気吸着量測定装置	日本ベル(株)	BELSORP-max	26	900	遠田
257	超純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU665DA	26	100	遠田
258	低温恒温恒湿器	タバイエスペック(株)	PL-3SP型	5	170	遠田
259	分光光度計	(株)日立製作所	U-3000	10	340	遠田
260	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent 7500 Series ICP-MS	18	1,650	遠田
261	イオンクロマトグラフ(陰イオン・陽イオン・糖分析システム)	ダイオネクス	ICS-3000+2100型	22	1,550	遠田
262	吸着性能評価装置	Quantachrome社	ChemBET-3000型	16	690	遠田
263	バイオシェーカー	タイテック(株)	BR-43FL-MR	23	100	遠田
264	分子量分布測定装置	(株)島津製作所	ProminenceGPCシステム	25	380	遠田

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
265	高感度ガスクロマトグラフ	(株)島津製作所	Tracera	27	460	遠田
266	微粉碎機	中央化工機(株)	MB-1	9	100	遠田
267	粗粉碎機	三田村理研工業(株)	SR-2	9	130	遠田
268	凍結粉碎器	日本分析工業	JFC-1500型	15	300	遠田
269	小型タンデムリング粉碎機	中央化工機商事(株)	TR-LM	24	100	遠田
270	アスファルトミキサー		北大型30k練2Hp	2	150	遠田
271	アスファルト用乾燥機			S46	100	遠田
272	ガスコンロ			S55	100	遠田
273	ローラーコンパクター	谷藤	TR-323C	S47	130	遠田
274	3連式自動ホイールトラッキング試験機	ニッケン	HKA-110A3D-CW15	8	740	遠田
275	蛍光X線膜厚計	セイコー電子工業	SEA-5120	6	1,400	岡田
276	薄膜構造評価用高輝度X線回折装置	理学電機	ATX-G	12	5,900	鈴木
277	電子スピン共鳴測定装置	ブルカー・バイオスピン社	EMXplus型(マイクロ波ブリッジ含)	25	1,800	鈴木
278	電子顕微鏡用引伸機	ダースト	L1200	5	790	岡田
279	イオンスパッタ装置	日本電子	JUC-5000	4	2,000	岡田
280	マイクロオージェ電子分光装置	日本電子(株)	JAMP-7830F	14	9,100	岡田
281	断面試料作製装置	日本電子	クロスセクション・ポリリッシャ9010	17	620	岡田
282	実体顕微鏡	オリンパス	SZH-141	4	340	岡田
283	透過型電子顕微鏡(TEM)	日立製作所	HF-2000	5	31,100	岡田
284	光電子分光装置(ESCA)	アルバックファイ	5600MC	4	17,600	千葉(隆)
285	卓上顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	Miniscope TM3030Plus,EDX:Quantax70	27	760	千葉(隆)
286	紫外分光式磁気特性評価装置	ネオアーク	BH-M800UV-HD-10	17	1,400	山根
287	クリーンブースA	日本エアテック	AER-2000C	9	100	山根
288	ポータブル型分光測定装置	ARCopix S.A.社	ARCspectro FT-NIR Rocket 0.9-2.6	26	200	山根
289	モノクロメータ式分光光源	朝日分光(株)	MAX-303+,CMS-100	27	200	山根
290	2次元光検出器	ビットラン	BQ-73LN	22	110	近藤(祐)
291	高感度マグネットメータ	プリンストンメジャメント社	MicroMag2900	5	4,400	鈴木
292	ディンプルグラインダ	VCR	D-500	4	1,700	岡田
293	ダイヤモンド研磨システム	マルトー	ML-150P	5	100	岡田
294	低速切断機	サウスベイテクノロジー	SBT650	5	100	岡田
295	恒温恒湿槽	ADVANTEC	AGX-224	7	310	櫻田
296	静電容量微小変位計	ナノテックス	PS-III-5D	16	100	櫻田
297	卓上プラズマエッチング装置	三友製作所	TP-50B	27	460	伊勢
298	純水・超純水製造装置	アドバンテック	RFU655DA・RFP543RA	22	240	近藤(祐)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
299	揺動式片面精密研磨機	不二越	LPS-38A	5	730	山川
300	ハイトゲージ	ハイデンハイ	CERTO-CT60M	6	420	山川
301	揺動式片面精密研磨機	ラップマスターSF	SPL15	6	1,500	山川
302	ダイシング・ソー	ディスコ	DAD320	7	1,450	内田(勝)
303	金属顕微鏡	ニコン	XPF-UNRB	4	950	伊勢
304	静電式パターニング装置	エンジニアリングシステム(株)	QDX500-V-XC	25	1,100	伊勢
305	イオンビームガン	アリオス	EMIS-212	17	430	内田(勝)
306	スパッタリング用パルス電源	日本MKS	RPG-50A-00	17	290	内田(勝)
307	スパッタ・蒸着複合装置	トッキ	SPS506	7	3,900	鈴木
308	分子線エビタキシー装置	エイコー・エンジニアリング	EW-100S	17	4,800	鈴木
309	MBEプロセスモニタ用四重極質量分析システム	英国ハイデン社		18	910	鈴木
310	スパッタ機用RFマッチングボックス	トッキ	RF-MN750	19	220	鈴木
311	MBE装置LL室拡張設備	株式会社エイコー		22	1,450	鈴木
312	MBE装置用成膜及び表面処理機能拡張設備	株式会社エイコー	1EK00-36109-6501	23	3,700	鈴木
313	補助ポンプ	サエスグループ(SAES Getters)	CapaciTorr D400-2	26	100	鈴木
314	バッチ式多元スパッタ装置	トッキ	SPM506	7	3,750	新宅
315	イオンミリング装置	コモンウェルス	ミラトロンIV	4	1,900	山川
316	クライオコンプレッサ	ブルックス・オートメーション社	8200空冷式	26	100	山川
317	ディスクスパッタ装置	日本真空技術	SSH-4S	5	12,300	山根
318	光学式表面解析装置	Gandela Instruments	OSA5100-200SQ	16	1,100	山根
319	リークデテクター	日電アネルバ	ASM120HS	4	810	内田(勝)
320	バッチ式多層スパッタ装置	日電アネルバ	SPF-540H特	4	2,500	伊勢
321	バッチ式スパッタ装置	日電アネルバ	SPF-332H	6	2,000	伊勢
322	超高真空多元スパッタ装置	アルバック	MPS-4000-C6	15	6,000	新宅
323	空冷インバーターチラー	オリオン機械(株)	REK2200B1-V-G2	25	120	新宅
324	レーザー直接描画装置	ハイデルベルク社	DWL 200UV	10	270	梁瀬
325	超音波洗浄装置	本多電子	W118	7	440	内田(勝)
326	工場顕微鏡システム	ニコン	MM-11U	4	2,950	伊勢
327	MEMS対応型マスクアライナ	ズース・マイクロテック	MA6BSA	15	1,950	伊勢
328	純水・超純水製造装置	日本ミリポア株式会社	Milli-Q Integral 10	21	230	鈴木
329	サンプリングオシロスコープ	レクロイジャパン	9354TM	7	150	黒澤(孝)
330	高速スペクトラムアナライザ	HP	E4401B	11	280	黒澤(孝)
331	高速パルスジェネレータ	HP	HP81110A	11	240	黒澤(孝)
332	ルビジウム周波数標準発振器	スタンフォードリサーチ	FS725	17	100	黒澤(孝)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
333	電波暗室・EMI測定システム	Rohde&Schwars	ESIB26a	16	9,550	黒澤(孝)
334	電波暗室用センサスキャナ	デバイス	DM3423AV1/0	19	210	黒澤(孝)
335	発振器	エヌエフ回路設計ブロック	WF1973	19	100	黒澤(孝)
336	ロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5640	19	100	黒澤(孝)
337	低ノイズアンプ	TSJ	MLA-00118-B01-35	20	100	黒澤(孝)
338	高利得マイクロ波アンテナ	Electro Metrics	EM-6969	21	100	黒澤(孝)
339	自動車用直流電源インピーダンス安定化回路網	Schwarzbeck Mess Elektronik	NNBM8125	21	100	黒澤(孝)
340	CISPR22対応電波吸収体	TDK	IS-030A	22	100	黒澤(孝)
341	電磁シールド特性評価システム	テクノサイエンスジャパン	KEC法測定システム	22	110	黒澤(孝)
342	雑音電力測定システム	(株)東陽テクニカ	MAC600A-AJ , EPS/RFP-AJ	25	100	黒澤(孝)
343	雑音測定用疑似通信回路網	協立電子工業(株)	KNW-2208, KNW-441, およびF-51	25	100	黒澤(孝)
344	高周波発振器	アンリツ	MG3692C	26	150	黒澤(孝)
345	放射・伝導イミュニティ試験システム	東陽テクニカ	IEC61000-4-3 ,IEC61000-4-6 2008対応	27	1,350	黒澤(孝)
346	電子負荷	(株)計測技術研究所	LN-300A-G7	26	100	木谷
347	電子負荷	(株)計測技術研究所	LN-300A-G7	26	100	木谷
348	EMC試験用交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000S+ES2000B×2台	27	250	木谷
349	MTF評価装置	トライオプティクス	Image Master HR LP	21	540	梁瀬
350	金属顕微鏡システム	オリンパス	BH3-MJL	6	1,500	梁瀬
351	分光エリプソメータ	日本セミラボ株式会社	SE2000	28	1,100	近藤(祐)
352	走査型プローブ顕微鏡(走査型トンネル顕微鏡)	デジタル・インスツルメンツ	ナノスコープⅢ	4	7,850	経徳
353	超微小硬度計	日本電気	MHA-400	4	14,700	経徳
354	大型サンプルSPM観測ステージ	デジタル・インスツルメンツ	D3000	7	2,200	経徳
355	走査型プローブ顕微鏡用駆動システム	Veeco	RDS-F/DSP	13	100	経徳
356	触針式表面形状測定装置	アルバック	DEKTAK150	21	250	千葉(隆)
357	ナノ加工用イオンビーム装置	セイコーインスツルメンツ(株)	SMI2050	14	4,000	近藤(祐)
358	クリーンブースB(H17導入)	日本エアテック	ECB02-22D5	17	120	近藤(祐)
359	FFTアナライザ	HP	HP35670A	5	1,150	森
360	加速度センサ	日本航空電子工業	JA-5VC3	5	350	森
361	デジタルオシロスコープ	HP	HP54542A	5	760	森
362	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1157	5	610	森
363	微小変位計光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1165	5	330	森
364	レーザードップラー振動計	小野測器	LV-1500	5	1,150	森
365	FFTサーボアナライザ	HP	HP35670A	7	630	森
366	タイムインターバルアナライザ	HP	HPE1725B	7	1,400	森

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
367	高分解能光ファイバー式変位計	フォトリクス	ATW-01 +ATP-A20	12	220	森
368	高周波連続可変フィルタ(H13導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	13	100	森
369	FFTアナライザー	アジレントテクノロジー	35670A	17	170	森
370	5ch 静電容量変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	17	100	森
371	オートコロメータ	ニコン	6B	18	220	森
372	高速・高精度制御装置	MED	NMC 7880	18	100	森
373	超高分解能光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BH20	18	100	森
374	平面検出型光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BZ	18	100	森
375	FFTアナライザー	小野測器	DS-2100	19	220	森
376	スペクトラムアナライザ	HP	HP4396B	9	920	櫻田
377	高分解能オシロスコープ	HP	HP54540C	7	390	櫻田
378	マイクロスコープ	ハイロックス	KH-7700	19	230	櫻田
379	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ (株)	BH20	20	100	櫻田
380	ロジックアナライザ	アジレントテクノロジー(株)	16804A	20	240	櫻田
381	オシロスコープ	アジレントテクノロジー(株)	DSO7104A	21	100	櫻田
382	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ	BH25, BD96-B1400HC特	21	110	櫻田
383	ファンクションジェネレータ(2ch出力)	テクトロニクス株式会社	AFG3252	21	100	櫻田
384	レーザ干渉変位計システム	株式会社小野測器	LV-2100	21	120	櫻田
385	除振台	明立精機	MAPS-008A-G1010	22	270	櫻田
386	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社	L-trace II	24	670	櫻田
387	レーザドップラ振動計	小野測器	LV-1800	25	140	櫻田
388	振動周波数分析器	株式会社エヌエフ回路設計ブロック	FRA5097	25	120	櫻田
389	ピコメートル分解能非接触変位計	(株)マグネスケール	BN100	26	100	櫻田
390	高分解能反射型レーザースケール	(株)マグネスケール	BF1,BD-96	26	100	櫻田
391	差動型非接触振動計	小野測器(株)	LV-1800	26	150	櫻田
392	微小トルク検出器	ユニパルス	UTM II -0.05Nm	26	100	荒川
393	GMR評価高磁界用マグネット電源	菊水電子工業	PBX20-20	10	100	山川
394	発振器	HP	HP81110A	11	240	木谷
395	スポットUV照射装置	東芝ライテック	トスキュア250	5	290	木谷
396	クリーンブースC(H17導入)	日本エアテック	ACB-352C-特型	7	120	木谷
397	光学顕微鏡	ニコン	MM-11U	7	580	木谷
398	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	9	430	木谷
399	ロングメモリオシロスコープ	レクロイ	LC574AL	11	670	木谷

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
400	オシロスコープ	AgilentTechnologies	54622A	12	100	木谷
401	スペクトラムアナライザ	AgilentTechnologies	E4411B	12	100	木谷
402	高精度スピンスタンド	協同電子システム	LS1000/500PS- II K	16	2,450	木谷
403	磁気抵抗測定装置	ハヤマ	MRMS-10K	20	3,700	鈴木
404	スイッチ・マトリックス	ケースレーインストルメンツ株式会社	4200-UL-LS-12	21	100	鈴木
405	GPIB直流電源装置	菊水電子	PB×40-5	5	260	千葉(隆)
406	スポット溶接機	松下電器	YG501SPF	5	300	丹
407	バランスングマシン	長浜製作所	RI00/RI0/RS1	16	320	森
408	小型旋盤	エムコ社	コンパクト8	5	580	櫻田
409	立型帯鋸盤	ラクソー	VWS-55	5	280	櫻田
410	静電力発生用高圧電源システム	松定プレジジョン	HAR-30P73.3	27	100	荒川
411	ハイスピードマイクロスコープ	キーエンス	VW-9000	28	400	荒川
412	偏光顕微鏡	オリンパス光学工業(株)	BHS-751-P型	S62	100	梁瀬
413	ワードジェネレーター	HP	HP8110A	7	100	梁瀬
414	顕微鏡用デジタルカメラ	ニコン	DS-Fi1	19	100	梁瀬
415	高フレームレートカメラ	Point Grey Research	Dragonfly Express DX-BW-CS	20	100	梁瀬
416	高性能LD光源	メスグリオ	56RCS002/HV	21	100	梁瀬
417	色彩輝度計	コニカミノルタ	分光フィッティング方式 CS-200	25	130	梁瀬
418	高速カメラ	(株)ディテクト	HAS-D3M	25	100	近藤(祐)
419	液晶配向シミュレータ	シンテック(株)	LCD MASTER 3D	18	190	梁瀬
420	ラビング装置	E.H.C(株)	MR-100	18	270	梁瀬
421	UV加圧硬化装置	E. H. C	MLP-320G	19	100	梁瀬
422	シール剤塗布装置	岩下エンジニアリング	Ez-ROBO5/ACCURA DG	20	100	梁瀬
423	アッペ屈折計	アタゴ	DR-M4/1550	21	100	梁瀬
424	ヘッド観察用顕微鏡セット(ポアスコープ)	オリンパス	G080-034-090-55	5	100	梁瀬
425	光スペクトラムアラナイザ	横河電機	AQ-6315B	16	330	梁瀬
426	照明光学系設計システム	Zemax社	OpticStudio Professional版	27	210	梁瀬
427	B-Hループメータ(解析装置付き)	テスラ	MODEL4800(解析装置: マイテック: 高感度 M-VSM500R)	4	1,350	山川
428	ズーム顕微鏡	ユニオン光学(株)	DZ2-SH	9	230	山川
429	LCRメータ	HP	HP4284A	7	600	森
430	軟磁性用振動試料型磁力計	マイテック	高感度 M-VSM500R	7	360	新宅
431	アンプ付き電流プローブ	ソニーテクトロニクス	AM503S+op05	11	100	木谷
432	デジタルオシロスコープ	LeCroy	WR6051A	16	100	木谷

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
433	ファンクションゼネレータ	ソニーエレクトロニクス	AFG2020	4	590	千葉(隆)
434	標準電圧電流発生器	アドバンテスト	R6161	5	230	千葉(隆)
435	マルチメータ	HP	HP3458A	5	330	千葉(隆)
436	一軸面内磁場印加マニュアルプローバ	ハイソル(株)	HMP-400SMS-Entry型	27	350	千葉(隆)
437	有限要素解析用計算システム	エムエスシーソフトウェア(株)	Marc2014AIT	26	1,600	荒川
438	インピーダンスアナライザ	HP	HP4291A	6	1,650	黒澤(孝)
439	カオス解析システム	コンピュータコンビニエンス		12	140	黒澤(孝)
440	誘電率測定フィクスチャ	Agilent	16453A	20	100	黒澤(孝)
441	大規模データ処理用並列分散計算クラスタリングシステム	IBM	eServer325	16	140	黒澤(孝)
442	スペクトラムアナライザ	アドバンテスト	R3361A	4	100	木谷
443	高周波連続可変フィルタ(H11導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	11	170	木谷
444	フォトリソグラフ用クリーンオープン	榎本化成	CSO-402BF	12	150	内田(勝)
445	アライナ用クリーンブース	三基計装株式会社	SCB-2-201520	21	100	内田(勝)
446	スピコータ	ミカサ株式会社	MS-A150	21	130	内田(勝)